

2018年7月17日

**研究用に機能・構造を単純化  
卓上真空プラズマ装置「YHS-O」2018年7月20日発売  
有機物のクリーニングや素材の表面改質**

プラズマ発生装置を開発・販売する株式会社 魁半導体(京都府京都市下京区、代表取締役 田口貢士)は、当社の卓上真空プラズマ装置 YHS シリーズに新たなラインナップとして酸素ガスを導入し有機物のクリーニングなどに利用できる「YHS-O」を開発、主に研究用として 2018 年 7 月 20 日に発売します。当社従来製品に比べ機能や構造を単純化し販売価格を抑えました。

**【開発背景】**

当社の真空プラズマ製品は洗浄やエッチング、薄膜形成など幅広い研究で利用されています。中でも卓上真空プラズマ装置「YHS」シリーズはコンパクトな卓上型として 2006 年の発売以降、多くの研究機関で利用されています。ガス導入型「YHS-G」は複数のガス導入に対応し流量調整や細かな処理条件の設定が可能な高機能製品として研究や生産現場でも利用されています。研究用途によっては導入ガスは酸素のみで単純な設定で利用されるケースも多く、ニーズに応じて都度スタマイズ対応していました。

今回「YHS-O」をシリーズのラインナップに加え、ガス導入は酸素に限定し、本体の機能や構造を見直して新たに開発、当社従来品の約 1/3 の価格設定で提供、また短納期化も可能にしました。

(写真:「YHS-O」本体・仮)

**[用途]** 素材の表面改質や、有機物のクリーニングなどの研究用途。

**[販売価格]** 63 万円(税別)から

**[目標販売台数]** 年間 30 台



## [真空プラズマ装置 YHS-O: 本体仕様]

型式	YHS-O (※O=オー)
外形寸法	(W)210 mm × (D)230mm × (H)315mm (突起部分を除く)
ステージ(処理電極)寸法	Φ100mm ・ 電極間距離 60mm
重量	約 6.0 kg
出力調整	調整不可 (最大時 約 50W)
ガス導入	接続: Swagelok 1/4 インチチューブ継手 ガス導入の ON/OFF は装置内部の電磁弁による 流量は前面パネルのニードルバルブによる手動調整
動作ガス	標準: O <sub>2</sub>
排気調整	調整不可
タイマー	設定値: 0~9999 秒(1 秒単位)
ポンプ接続	内径 15mm 真空ホース用継手 ※真空ホース類やクランプは付属しません。
真空計	なし

※真空ポンプはオプション

[ユーティリティー](本体に付属していません。ご利用時にご用意ください)

電源	単相 100V、60Hz、10A
動作ガス	標準: O <sub>2</sub>

 ◆真空プラズマ装置「YHS-O」製品紹介ウェブページ <https://sakigakes.co.jp/item.php?ii=70>

【お問合せ先】

 株式会社 魁半導体 <https://sakigakes.co.jp/>

 TEL: 075-204-9589 / FAX: 050-3488-5883 / E-mail: [s.sales@sakigakes.co.jp](mailto:s.sales@sakigakes.co.jp)

住所: 京都府京都市下京区西七条御前田町 50 番地 SAKIGAKE ビル